435

導電性セラミックス/金属接合体の残留応力分布

秋田県工業技術センター 秋田大学工学資源学部

〇木村光彦 浅利孝一 後藤正治 麻生節夫 大口健一

Distribution of Residual stress on Electrical Ceramics/Metal Joint by Mitsuhiko KIMURA, Koichi ASARI, Shoji GOTO, Setsuo ASO and Kenichi OHGUCHI キーワード:残留応力, X線, セラミックス

Keywords: Residual stress, X-Ray, Ceramics

1. はじめに

放電加工により複雑形状に加工可能な導電性セラミックスと金属接合体の実用化が期待さ れている. セラミックス/金属接合体の強度的な信頼性を確保するためには、接合行程の冷却 時に発生する残留応力について把握することが非常に重要である、そこで、本研究では、導 電性サイアロンと金属接合体の信頼性評価法を確立するための第一段階として, 導電性サイ アロンと SKS3合金工具鋼を、2種類のろう層厚さで活性金属ろうを用いて真空ろう付けし、 その接合体の残留応力測定,及び接合体構成材料の引張試験結果などに基づき数値解析的考 察を実施した.

2. 実験方法

2.1 接合方法

本実験で用いた試料は、25×5×20mm の 寸法の、セラミックスとして導電性サイア ロン (日立金属株) HCN-40), 金属として合 金工具鋼(SKS3)であり、ろう材は Ti 入り銀 ろう (田中貴金属㈱70.5Ag27.5Cu2Ti) を用 いた、各試料表面を平面研削盤により研削 仕上げ(Ry<2μm)したのち, それぞれアセ トンで超音波洗浄を300s行って使用した.

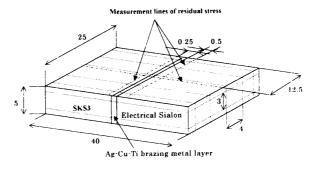


Fig. 1 Schematic view of brazed joint sample.

真空中(5.0×10^{-2} Pa 程度)で W ワイヤーを(直径100, $400 \, \mu$ m)接合面の両端に置くことによ りろう層厚さを制御して, Ti 入り銀ろうを用い25×5mm の面で接合し, Fig. 1に示す25×5 imes 40mm の接合試験片を作製した、接合は1113K, 300s の条件で行い,その際のろう層厚さ $(100, 400 \, \mu \, \text{m})$ が、接合体の残留応力分布に対しどのように影響するかについて検討した.

2.2 残留応力測定方法

接合体の残留応力の測定は、接合試験片の セラミックス側,及び金属側を X 線応力測定 法により行った. 測定条件を Table 1に, 測定 位置を Fig. 1に示す. 金属側については, 真 空炉でのろう付けにより研削加工による残留 応力がキャンセルされるため、測定値を接合 *(250GPa, 0.19, 127deg)''

Table 1 Condition of X-Ray stress analysis.

Cr-K α	40(kV), 40(mA)	40(kV), 40(mA)
Diffraction	(311) plate of TiN	(211) plate of Fe
Incident colimator	φ1.0(mm)	φ 0.5 (mm)
Stress constant, K	-914.1 (MPa/deg.)*	-318.0 (MPa/deg.)
Detector	PSPC with V Filter	PSPC with V Filter

溶接学会全国大会講演概要 第71集(2002-10)

による残留応力とすることができる、セラミックス側については、研削加工による残留応力 が真空炉ろう付けでキャンセルされないため、接合による残留応力の影響が無い接合界面か ら10mm 以上の測定値を平均し、研削加工による残留応力値として差し引いた.

3. 結果及び考察

3.1 接合体の残留応力分布

Wワイヤーを用いてろう層厚さを100, 400 µm に制御して接合した接合体の中 心線上の残留応力 σ x分布を Fig. 2に, σ y分布を Fig. 3示す. 接合体の接合界面 に平行な方向の残留応力σ κは、ろう材と の界面において、セラミックス側及び金 属側の値がそれぞれ圧縮応力及び引張応 力となり、その絶対値がよく一致した. その絶対値はセラミックス側及び金属側 共に接合界面から5mm 程度まで100MPa 程度と比較的高い値を示した。また、ろ う層厚さ100μm に比較して, 400μm の 場合は若干残留応力値が小さくなった. 接合界面に垂直方向の残留応力 σ,は、接 合界面では、それぞれセラミックス側で 引張応力, 金属側で圧縮応力を示した. その絶対値はセラミックス側ではσ、に比 較すると、より界面近傍で高い値を示 し、数 mm 離れると残留応力は無くなっ た、金属側では接合界面近傍で圧縮応力 を示すが、界面から離れると引張応力へ と変化し、5mm 程度離れた位置でもσx と同様に100MPa程度の応力を示した. この金属側のσ,応力変化は、栗田²)らの 3次元 FEM 解析結果とよく一致してい る. また, ろう層厚さ100 μ m に比較 Fig. 3 Relation between residual stress σ_{y} and 側,及び金属側共に接合界面近傍の残留 layer.

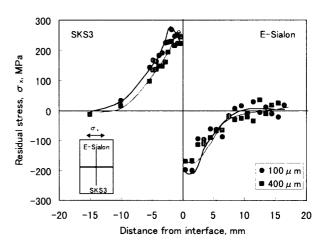
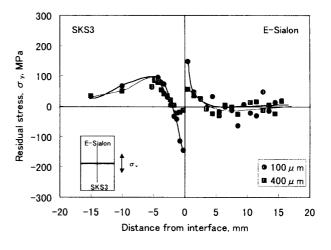


Fig. 2 Relation between residual stress σ_x and distance from interface brazed for 300s at 1113K with 100μ m and 400μ m thickness of brazing metal layer.



distance from interface brazed for 300s at 1113K し, $400\,\mu\,\mathrm{m}$ の場合は, セラミックス with $100\,\mu\,\mathrm{m}$ and $400\,\mu\,\mathrm{m}$ thickness of brazing metal

応力値がσχよりも大きく低下し、接合試験片から切り出した曲げ試験片の4点曲げ強度の差 によく一致した.

参考文献

- 1) Tatsuya Matsue, Takao Hanabusa and Yasukazu Ikeuchi, "X-Ray Study on Repeated Bending Loading Process of TiN and TiC Coated Materials", J. Soc. Mat. Sci. Japan, 45-10, (1996), P1119-1124.
- 2) Masanori Kurita, Kiyohiro Yoneda, Jun Iijima and Akira Saitoh, "Three-Dimensional Residual Stress Analysis for Silicon Nitride Brazed to Streel Plate", J. Soc. Mat. Sci, Japan, 42-477, (1993), P620-626.